

ASDevices製品エコシステムを搭載した、プロセスおよびラボ用途向けの高品質・高性能ガスクロマトグラフで、電源はASDevices製品エコシステムを使用

- メンテナンス性を考慮した初のプロセス&ラボ用ガスクロマトグラフ。機器をラックから取り外すことなく、主要なGCコンポーネント全てにアクセス可能。
- モジュラー式オープン設計（特許出願中）による安定性と性能の向上。全てのバルブとカラムは制御された温度で維持されます。
- リーク耐性を向上させ、キャリアガス消費量を削減する独自の電子式圧力調整器。
- 安定化電極と集束電極の独自組み合わせにより性能を向上させる強化プラズマ放電検出器（EPD）特許出願中を基盤としています。このメンテナンスフリーの検知技術は、FID、PDHID、PED、RGDなどを置き換える自然な選択肢であり、1992年に導入された従来の技術（Kontrol Analytik™）を大幅に強化したものです。



主な特長

1 高度なデジタル信号処理プラットフォーム

- 高度な信号フィルタリングおよびピーク検出アルゴリズム
- スペクトル補償アルゴリズム
- 4 x 24 ビット高分解能・高速測定チャンネル（オプションで 8 入力）

2 独自の組み込み型GCプラットフォームおよびソフトウェア

- 産業用グレードのタッチスクリーンディスプレイと直感的なユーザーインターフェイス
- 堅牢な産業用グレードのオペレーティングシステム
- 統計データ解析
- 1ヶ月分の内部データ保存とクロマトグラム
- 高度なデータ分析と診断機能
- IIoT対応
 - クラウドデータストレージ
 - リモート監視・制御
 - MQTTプロトコル

オプション

- 最大8つの絶縁型4-20mA出力最大8つのデジタルリレー出力
- RS-232通信
- シリアル通信プロトコル内蔵希釈システム
-
-



ラボ版
(ベンチトップ)



プロセス版
(ラックマウント)

主な用途

測定例

常在ガス炭化水素VOC
BTEX
塩素系炭化水素

硫黄化合物
温室効果ガス農薬
ニトリル類ア
ルデヒド類

アルコール水分メルカプ
タン
あらゆる有機分子

強化プラズマ放電が他の技術に比べ持つ利点

強化プラズマ放電技術は、多くの種類の検出器を代替可能です。主な利点は下記の表にまとめられています。

検出器	強化プラズマ放電の利点
FID	<ul style="list-style-type: none"> ▼ 炎用可燃性水素および空気は不要 ▼ FIDによる微量測定にUHP水素および空気浄化システムが不要 ▼ COおよびCO₂のモニタリングにメタン化装置が不要 ▼ 感度向上 ▼ メンテナンス不要
DID/PDID	<ul style="list-style-type: none"> ▼ 低コストのアルゴンをキャリアガスとして使用可能 ▼ 排ガスおよび関連する高価な浄化システムが不要 ▼ 選択的モードまたはユニバーサルモードでの使用が可能 ▼ 感度が向上 ▼ DIDおよびPDIDは放電電極のメンテナンスが必要 ▼ オンライン検出器として使用可能
FPD	<ul style="list-style-type: none"> ▼ 可燃性水素と炎用空気は不要 ▼ 微量測定に超高純度水素および空気浄化システムが不要 ▼ メンテナンス不要 ▼ 放射性源不要
ECD質	<ul style="list-style-type: none"> ▼ 永久性ガスや水分など多くの分子に対する感度向上 ▼ 取得コストと運用コストの低減
量分析計 分光計	<ul style="list-style-type: none"> ▼ 真空ポンプは不要 ▼ サブppbレベルからパーセントレベルまでの測定が可能
TCD	<ul style="list-style-type: none"> ▼ 水銀を使用しない ▼ UVランプのメンテナンス不要
RCP または RGD	<ul style="list-style-type: none"> ▼ メンテナンス不要



**プロセスGC
超微量測定**

主な用途	半導体製造
	特殊ガス
	電子ガス、ASU

仕様 | **Ka** プラ
8000

バックグラウンドサンプルガス	H ₂ 、O ₂ 、N ₂ 、Ar、He、CO ₂ 、CDA
検出限界	H ₂ < 0.1 ppb
	CO < 0.1 ppb
	CO ₂ < 0.1 ppb
	CH ₄ < 0.1 ppb
	NMHC < 0.1 ppb
	N ₂ 0.1 ppb未満
	Ar < 0.1 ppb
	硫黄 < 0.5 ppb
サンプル圧力サンプル流	5~30 PSIG
量キャリアガス圧力	0~200 cc/min の間で調整可能
キャリアガス流量	80~100 PSIG
	用途に応じて。キャリア流量・圧力コントローラー付属
キャリアガス種別	精製5Nアルゴン、ヘリウム、窒素、CO ₂ および混合キャリアも特定の用途で必要であれば可能。
GCバルブユーザー選択外形図	ユーザー選択 (ASD PLSAバルブ推奨) H: 312 mm W: 483 mm D: 508 mm (プロセスバージョン)

仕様 | **ASDPure™**
(希ガス精製装置)

ガス浄化	Ar、He、Ne、Xe、Kr (Nはオプション)
除去される不純物達成可能な	H ₂ O、O ₂ 、CO、CO ₂ 、H ₂ 、THC、CH ₄ 、N ₂
純物レベル	< 1 ppb
公称流量	300 mL/min (オプションで1 L/min)
継手	ASD LipLOK™ 継手、計測機器用ダブルフェルルールタイプまたはVCR™に対応
供給電源 消費電力 重量	115 VAC または 220 VAC、50-60 Hz
外形図	最大100ワット (用途により異なる)
	1.6 kg
	高さ: 300 mm 幅: 82 mm 奥行: 82 mm